



设备简介

GL400 SR-V是天仁微纳全自动步进式 (Step & Repeat) 紫外纳米压印光刻生产线,可高效地进行母模具制作或在基底上进行复杂结构的直接图案化,拼版单元尺寸可灵活定义,轻松应对各种母版由小转大需求,最大压印面积可达400mm×400mm,降低纳米压印光刻母模具的制作成本,使低成本纳米压印生产成为可能。

GL400 SR-V纳米压印光刻设备可用于生产适配于天仁微纳全自动纳米压印光刻生产线设备所需的大幅面母模具,实现AR/VR、AR HUD、衍射光学器件、超表面和生物芯片的高效率大批量生产。

GL400 SR-V
全自动步进式纳米压印光刻生产线

设备参数

兼容基底尺寸	8 inch & 12 inch晶圆
	200 mm×200 mm、300 mm×300 mm、
	310 mm×310 mm、320 mm×320 mm & up to
	400mm×400mm方形基底
支持基底材料	兼容玻璃、硅片、石英等
纳米压印技术	步进式紫外纳米压印
最大拼版单元尺寸	80 mm×80 mm
压印精度	优于10 nm*
对位精度	优于1 μm*
紫外固化光源	紫外LED (365 nm) 面光源, 准直光源, 水冷冷却
自动压印	支持
自动涂胶	Spin coating & Inkjetting
自动脱模	支持
后固化处理	支持

*参数取决于模具、材料、工艺和使用环境, 非设备极限
*天仁微纳保留对信息的解释权

主要功能

- 全自动步进式纳米压印光刻生产线, 最大压印面积400mm×400mm;
- 步进式纳米压印方式, 确保转印精度一致性, 大幅度降低大面积纳米压印母模具加工成本;
- 高精度压印胶涂布单元, 可选用Inkjet或Spin coating 涂布方式;
- Cassette to cassette自动上下片, 光学巡边预对位;
- 全自动步进式纳米压印光刻流程, 包括自动对位、自动压印、自动曝光固化、自动脱模等;
- 标配高功率紫外LED面光源 (365 nm), 水冷冷却、特殊功率以及特殊、混合波长光源可订制, 完美支持各种商用纳米压印材料与制程;
- 提供全套纳米压印工艺与材料以及工艺流程, 帮助客户零门槛达到国际领先的纳米压印水平。

OUR CONTACT!

联系方式
青岛天仁微纳科技有限责任公司
青岛市城阳区祥阳路106号 青岛未来科技产业园6号楼
电话: 0532-67769322
传真: 0532-67768286
电子邮件: contact@germanlitho.com
网址: www.germanlitho.com

Qingdao GermanLitho Co., Ltd.
Building 6, No.106 Xiangyang Rd.,
Chengyang District Qingdao Future
Science and Technology Industrial
Park, China
Tel: 0532-67769322
Fax: 0532-67768286
E-mail: contact@germanlitho.com
Web: www.germanlitho.com